

LY, MA, MD, MG, MK, MN, MU, MW, MX, MY,
MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL,
PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK,
SL, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA,
UG, US, UZ, VC, VN, WS, ZA, ZM, ZW.

(84) 指定国(表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO(BW, CV, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SC, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア(AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), ヨーロッパ(AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, ME, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI(BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

一 国際調査報告(条約第21条(3))

the substrate processing device. The cassette conveyance mechanism includes: a placement part on which the cassette is placed; and a movement mechanism that moves the cassette placed on the placement part.

(57) 要約: カセットに収納して搬送される基板に対して処理を施す基板処理装置であって、前記基板を内部で搬送する少なくとも1つの搬送ブロックと、前記基板に処理を施す基板処理モジュールと、前記カセットを、前記基板処理装置の外側面に設定される受渡位置と、前記基板処理装置の内部への搬入出位置との間で搬送可能に構成されたカセット搬送機構と、を有し、前記カセット搬送機構は、前記カセットを載置する載置部と、前記載置部に載置された前記カセットを移動させる移動機構と、を備える。